

秋田県産業技術センター

施設・設備リスト

2022.10.01 企画事業部

秋田県産業技術センター 施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術支援・相談、技術者育成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。

当センターは、県内企業をはじめ外部の方に施設や設備機器を以下のとおり開放しております。

ご利用の留意事項

(1)利用者

特に制限はありません。

(2)利用対象施設、設備機器および使用料金

施設および設備使用料に記載しているとおりです。

(3)利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4)利用・申し込み方法

あらかじめ電話等により、対象設備、利用日時等をご連絡のうえ、当日まで申請手続きが必要です。
使用が可能な場合は、許可証を交付します。

(5)使用方法

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6)支払い方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付ください。

(7)ご利用にあたっての遵守事項

- ①会議室等の使用に際しての机、椅子の準備および復旧は、使用者の責任において行ってください。
- ②茶器は無償で貸付しますが、消耗品はお持ちいただき、後片付けは使用者の責任において行ってください。
- ③敷地内（駐車場・駐車中のお車の中を含む）は、全面禁煙です。
- ④設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物および有害物質の持ち込みを禁止します。
- ⑤当センターの施設および設備機器をき損した場合は、直ちに届出願います。
故意または過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じますので、ご注意ください。

【申し込み・照会先】

秋田県産業技術センター 共同研究推進部

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番地の11

TEL 018-866-5800

FAX 018-866-5803

Eメール soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

ホームページ <http://www.aitc.pref.akita.jp>

施設使用料および設備使用料

1. 開放研究室

(1)本館

区分	面積[m ²]	室数	使用料金(円/月)
開放研究室A	59	1	71,130
開放研究室B	46	6	67,890
開放研究室C	40	2	45,260

(2)高度技術研究館

区分	面積[m ²]	室数	使用料金(円/月)
高機能開放研究室	61.44	5	99,630

2. 講堂・研修室・会議室・展示室

(1)本館

区分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00~12:00	13:00~17:00	9:00~17:00
講堂	100	3,600	4,800	8,400
研修室B	20	1,110	1,480	2,590
展示室	1,360(1日)			

以下の付属備品が利用できません(無料)ので、施設の使用申請の段階でお申し込みください。

液晶プロジェクタ、スクリーン、ホワイトボード、ワイヤレスマイク

(2)高度技術研究館

区分	収容人数[人]	使用料(円)		
		9:00~12:00	13:00~17:00	9:00~17:00
視聴覚研修室	100	9,900	13,200	23,100
研修室 A	24	3,600	4,800	8,400

付属設備

区分	使用単位	使用料(円)	
視聴覚研修室	一式 1 時間 につき	映像装置	2,150
		同時通訳装置	1,620
研修室 A		拡声装置	530

3. 機器設備

次頁以降の一覧表をご参照ください。

- (注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料となります。
- (注2) 付属装置の設備使用料が追加される場合があります。
- (注3) 機器設備の名称に ※印 のある設備は、担当者に直接お問い合わせください。

秋田県産業技術センター機器設備一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
1	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト	HFSSV・10・0	H17	970	熊谷(健)
2	3次元電磁界最適化設計ツール	アンソフト・ジャパン(株)	Optimetrics	H18	110	熊谷(健)
3	電磁界解析用ワークステーション	DELL	PrecisionT5400	H20	110	熊谷(健)
4	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング(株)	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	H28	220	熊谷(健)
5	レーザーカッター	エピログ社	Epilog Mini 24	H29	270	熊谷(健)
6	非接触ジェットディスペンサー	武蔵エンジニアリング	AeroJet	R02	100	熊谷(健)
7	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	H17	110	丹
8	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	H04	440	丹
9	非接触3次元デジタイザー	Steinbichler	COMET	H21	1,990	内田(富)
10	電源ノイズ測定器	(株)TFF(テクトロニクス)	MDo4104-6	H23	250	佐々木(大)
11	全光束測定システム	オーシャンフォトニクス	OP-FLUX-76-CA	H23	2,410	梁瀬
12	精密騒音計	リオン(株)	NL-52	H25	100	内田(勝)
13	超高精度3次元測定器	Panasonic	UA3P-300	H20	2,930	久住
14	非接触式表面性状評価装置	Zygo	NewView6300	H19	1,150	久住
15	非接触式フィゾー干渉計	Zygo	GPI XP/D	H19	580	久住
16	4インチ光学原器	Zygo	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	H21	300	久住
17	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	ZYGO	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	H23	140	久住
18	総合型金属顕微鏡	オリンパス(株)	DSX500,DSX100	H25	540	内田(富)
19	CNC3次元測定機	カールツァイス(株)	PRISMO 5 HTG-S	H07	470	加藤
20	真円度測定機	ランクテラーホブソン	タリロンド262型	H08	110	加藤
21	CNC3次元測定機用データ処理装置	(株)東京精密	Calypsoシステム	H18	850	加藤
22	超高倍率3次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	H17	1,680	加藤
23	非接触形状測定顕微鏡 ※	キーエンス	VK-9500	H15	1,030	熊谷(篤)
24	表面粗さ測定機	(株)東京精密	サーフコム 3000A-3DF-DX-S	H13	120	加藤
25	高精度CNC画像測定機	(株)ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	H27	800	加藤
26	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	PTC社	Pro/ENGINEER Wildfire 4	H10	110	内田(富)
27	3D鋳型積層造形装置	シーメット社	SCM-10	H27	4,950	内田(富)
28	3次元X線CTシステム	(株)東芝	TOSCANER-32300μFD	H28	2,850	内田(富)
29	鋳造CAEシステム	クオリカ	JSCAST	H29	580	内田(富)
30	3Dハイエンドプリンターシステム	ストラタス社	J750	R01	8,850	内田(富)
31	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	Solidworks	H28	500	内田(富)
32	3D形状計測システム	東京貿易テクノシステム	VMC7000M	R02	3,000	黒沢
33	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋(株)	KS-1703型	H07	160	遠田
34	管状炉	タナカテック	MPH-6VGS	H15	520	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
35	炭化賦活炉	(株)ウエーブニ十一	炭化賦活炉 T-2000L	H16	1,210	遠田
36	ナノバブル評価装置	マイクロトラック・ベル(株)	ZetaView-PMX100SP	H29	410	遠田
37	振動試験機 ※	エミック(株)	F-03000BM/FA	H16	1,210	熊谷(篤)
38	空圧落下衝撃試験装置	ボックス・ブラウン(株)	SM-110-MP型	H03	110	伊藤
39	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	H21	1,210	菅原
40	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工(株)	ZEM/PEM-1型	H09	1,410	関根
41	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ(株)	UMS-HL	H10	3,410	関根
42	ナノインデント ※	米国Hysitron社	Model Triboscope他	H14	3,040	熊谷(篤)
43	熱膨張測定装置	理学電機	Thermo Plus 2	H15	470	関根
44	電界放射走査電子顕微鏡	日立製作所	S-4500	H08	620	菅原
45	S-4500用オートステージ	日立製作所	S-8432型	H12	110	菅原
46	電子プローブマイクロアナライザー	日本電子(株)	JXA-8200ほか	H13	1,680	菅原
47	3次元ひずみ解析システム	(株)レーザー計測	VIC-3D	R03	2,000	黒沢
48	圧縮成形機	東洋精機(株)	試験用加硫プレス 30ton f	S58	280	工藤
49	プラスチック衝撃試験機	上島製作所	シャルピー-JIS7111	S58	110	工藤
50	3D射出成形シミュレーションシステム	富士通(株)	CELSIUS W480-NTM	H23	1,150	工藤
51	示差走査熱量計	(株)日立ハイテクサイエンス	X-DSC7000	H23	630	工藤
52	プラスチック万能材料試験機(CFRP用)	インストロン(株)	5967型	H24	940	工藤
53	メルトインテグサ	(株)東洋精機製作所	型式G-01	H25	250	工藤
54	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	H19	110	工藤
55	電子天秤	ザルトリウス(株)	MC210S	H10	110	工藤
56	3次元CAD/CAMシステム	CNC Software	Mastercam他	H19	1,620	加藤
57	色彩色差計	日本電色工業(株)	SQ-2000	H12	290	工藤
58	フーリエ変換赤外分光光度計	日本分光(株)	IRT-7000	H21	840	工藤
59	粘弾性測定装置	Anton Paar社	MCR302	H26	1,120	工藤
60	低高抵抗率測定システム	(株)三菱アナリック	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	H26	210	野辺
61	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	H28	100	野辺
62	デジタル硬度計	テクロック	GSD-1	H29	100	野辺
63	熱分析装置	(株)リガク	TG-DTA8122 / TMA8311(-S) / TMA8311(-H) / DSC8271 / DSCvesta	R02	1,120	関根
64	小型電気炉	(株)セイシン企業	PART-3	H02	260	菅原
65	電動式塗工機	(株)小平製作所	YOA-B型	H18	110	菅原
66	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	H21	430	関根
67	超硬製転動ミル用容器	(株)伊藤製作所		H20	110	関根
68	マイクロビッカース硬度計	(株)マツザワ	AMT-X7FS-B	H28	270	関根
69	X線応力測定装置	(株)マックサイエンス	MXP3AHP	H07	1,730	黒沢
70	スクラッチ試験機	新東科学(株)	TYPE.22H	H06	400	黒沢

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
71	微小硬さ試験機	(株)フィッシャー・インストルメンツ	H-100	H14	490	黒沢
72	X線残留応力測定装置	パルステック工業(株)	m-X360s	R02	750	黒沢
73	原子吸光分光分析装置	日本ジャーレルアッシュ	SOLAAR M-6	H15	1,100	工藤
74	酸素・窒素分析装置 ※	(株)堀場製作所	EMGA-620W/C	H13	1,360	熊谷(篤)
75	炭素・硫黄分析装置	LECO社	CS-200型	H13	890	工藤
76	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)	iCAP6300 Duo	H23	3,670	工藤
77	X線回折装置	リガク	RINT-2500	H09	720	菅原
78	低温灰化装置	ヤマト化学	PDC-210	H15	680	工藤
79	電気マッフル炉	アドバンテック東洋	FUS612PA	H15	360	工藤
80	ドラフトチャンバー	(株)ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	H27	730	工藤
81	精密旋盤	池具鉄工	D-20型	S47	260	加藤
82	ドリル研削盤	(株)藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
83	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	110	加藤
84	直立ボール盤	(株)吉田製作所	YUD600	S47	110	加藤
85	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S46	110	加藤
86	超精密成形形状研削盤	ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	H22	3,670	加藤
87	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシーンツール	PSB-350U	H12	280	加藤
88	ワイヤーカット放電加工機	(株)ソディック	AQ360L	H18	1,010	加藤
89	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ(株)	MU-400V II 型	H26	2,740	加藤
90	NCフライス盤	(株)山崎技研	F-352	R03	1,280	加藤
91	プラスチック粉砕機	ホーライ	VC3-360	H12	240	工藤
92	鋳型焼成雰囲気炉	日新化熱工業(株)	EBS-9(改)	H10	1,310	内田(富)
93	チタン用精密鑄造機	吉田キャスト	YSE-100	H28	1,270	内田(富)
94	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機	CYP-90	H20	290	菅原
95	マイクロフォーカスX線装置 ※	日本フィリップス(株)	HOMX-161	H05	1,830	熊谷(篤)
96	プレス付真空熱処理装置	東京真空(株)	PRESS-VAC-2	H03	580	黒沢
97	交直両用TIG溶接機	(株)ダイヘン	AVP-3000P	H13	740	黒沢
98	真空チャンバー	日本精機	φ500×H250 mm(内寸)材質:SUS304	H14	280	黒沢
99	レーザ加工装置	レーザライン	LDM3000-60	H29	1,900	黒沢
100	冷間等方加圧成形装置	アプライドパワー・ジャパン(株)	CIP-50-2000	H07	310	関根
101	多目的高温炉	富士電波工業	ハイマルチ5000	H08	1,040	関根
102	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業(株)	SPS-2080	H08	5,400	関根
103	高速精密切断装置	平和テクニカ(株)	HS-100G II	H29	300	関根
104	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	110	黒沢
105	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200 II	H22	1,780	黒沢
106	磁気探傷機	(株)島津製作所	PRA-80型	S46	230	黒沢
107	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	510	黒沢

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
108	X線透過検査装置	理学電気工業(株)	300EG-B2L型	S55	1,000	黒沢
109	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジーズ・ジャパン(株)	USM35X JE	H23	160	黒沢
110	3Dプリンターシステム	STRATASAS	FORTUS250mc	H25	1,120	内田(富)
111	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア(株)	Marc2014AIT	H26	1,620	大竹
112	協働ロボット遠隔操作システム	ユニバーサルロボット/アスラテック	UR5e/V-Sido Webconnect	R02	540	大竹
113	双腕型協働ロボット	(株)川田工業	Nextage	R01	810	小松
114	ビッカース硬度計	(株)アカシ	AVK-C2500	H04	110	内田(富)
115	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田(富)
116	電解研磨装置	スルアス社	ポレクトロール	H09	230	黒沢
117	試料研磨琢磨機	ビューラー	エコメット4000	H20	720	内田(富)
118	試料研磨琢磨機	丸本	DAP-2	S58	720	瀬川
119	セラミックス研磨装置	丸本ストラウス(株)	アブラミン	H10	2,670	関根
120	セラミックス自動精密切断機	丸本ストラウス(株)	アキュトム50	H11	400	関根
121	万能材料試験機	Instron	5985	H22	2,460	黒沢
122	小型造粒機	日本アイリッヒ(株)	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	H02	200	菅原
123	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28~100 bpm	H01	110	菅原
124	中型電気炉	(株)モトヤマ	SH-3045E	H10	900	菅原
125	遊星回転ボールミル	(有)伊藤製作所	LA-PO412	H08	210	関根
126	アトライタ	日本コークス工業(株)	MAISE-X	H25	350	関根
127	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業(株)	FMミキサ、FM10C/I-X型	H26	910	関根
128	真空溶解炉	富士電波工業(株)	FVPM-10型	H07	1,890	内田(富)
129	ニューマブラスター	(株)不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田(富)
130	動的ひずみ解析装置	(株)共和電業	EDX-1500A-16AC	H10	110	内田(富)
131	エアブラストマシン	(株)不二製作所	SGF-3(A)	R02	500	内田(富)
132	エアブラストマシン	(株)不二製作所	SGF-3(A)	R02	500	内田(富)
133	発光分析装置	(株)SPECTRO Analycal	SPECTROLAB M	H14	1,310	内田(富)
134	シャルピ衝撃試験機	(株)島津製作所	30kgm型	S54	140	内田(富)
135	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	H19	700	黒沢
136	スガ摩耗試験機	スガ試験機(株)	NUS-ISO-3型	H01	170	関根
137	摩耗試験機	(株)エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	H09	420	関根
138	標準試験片作製金型	AXXICON社	AIM Mould System	H13	230	工藤
139	ベント式射出成形機	日精樹脂工業(株)	NEX110-IV-12EG φ32ベント式可塑化ユニット	R02	1,780	野辺
140	押出機	(株)テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スクリュー径25φ	H16	1,620	工藤
141	集塵機	アマノ(株)	PIE45	H18	490	工藤
142	樹脂乾燥機	アドバンテック東洋	DRL823WA	H16	220	工藤

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
143	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	H13	110	久住
144	平坦度測定装置	(株)ニデック	FT-900(ウェハ用)	H25	1,270	久住
145	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	H09	130	丹
146	電界制御装置	トレック・ジャパン(株)	MODEL20/20B	H10	110	久住
147	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60-1970	H20	110	久住
148	除振台	明立精機	AYA-1809K4	H21	110	久住
149	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	H14	110	久住
150	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250/オートメット250	H28	160	久住
151	電界砥粒制御用多機能ワイヤーソー	(株)タカトリ	WSD-K2	H30	1,010	久住
152	電源装置	トレックジャパン(株)	MODEL609D-6	H07	190	久住
153	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレットパッカード	33120A	H11	110	久住
154	オンロスコープ	日本ヒューレットパッカード	HP-54645A	H11	110	久住
155	材料物性測定装置	東陽テクニカ	1260-MAS(ソーラートロン)	H18	700	久住
156	ゼータ電位測定装置	Systemex	Nano Z	H19	340	久住
157	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	H25	100	久住
158	動的光散乱式測定装置	(株)Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	H26	810	久住
159	安全キャビネット	エアーテック	BHC-1006 II A/B3	H20	110	中村
160	核酸増幅システム	三洋電機バイオメディカ(株)	MDF-192	H17	310	中村
161	蛍光顕微鏡	ニコン	E400-RFL 1	H15	200	中村
162	サーマルサイクラー	Bio-Rad	T100	H27	100	中村
163	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	H27	100	中村
164	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	H28	100	中村
165	フローサイトメーター	ベックマン・コールター社	CytoFLEX 3レーザー13カラー	H28	1,220	中村
166	研磨装置	不二越機械工業	SLM-140	H22	490	久住
167	片面研磨装置	不二越機械工業(株)	SLM-140改	H25	560	久住
168	高速引張試験機	島津製作所	HITS-T10	H21	2,410	黒沢
169	落錘衝撃試験機	INSTRON	9205HV	H21	1,470	黒沢
170	材料試験高速解析システム	(株)フォトロン	FASTCAM SA-X	H24	800	黒沢
171	減圧除湿乾燥機	カワタ(株)	DV-30	H26	250	野辺
172	高転写成形用急加熱冷却金型システム	山下電気(株)	超臨界発泡射出成形機用金型	H26	1,110	野辺
173	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ	PIE-30SD	H22	780	加藤
174	立形マシニングセンタ	ファナック	α-T14iD	H16	470	加藤
175	複合材硬化成形用オートクレーブ	(株)羽生田鉄工所	φ850 x 1500L	H21	1,470	藤嶋 基
176	複合材料切断機	(株)丸東製作所	AC-300CF	H22	580	藤嶋 基
177	フラットベット切断機	(株)ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	H25	760	藤嶋 基
178	複合材料圧縮成形装置	(有)郷製作所	MBO05-GMS	H27	1,410	藤嶋 基
179	超臨界発泡射出成形機	日精樹脂工業(株)	NEX180Ⅲ 25E	H24	3,040	野辺

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
180	プリント基板加工システム	日本LPKF(株)	Protomat C100HF	H16	460	久住
181	ロボットシミュレーションシステム	(株)シーエムエス	Visual Components 3D Automate	R01	730	大竹
182	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	H27	100	丹
183	直流安定化電源	菊水電子工業(株)	PAT80-100T WITH USB	H27	180	佐々木(大)
184	電子負荷装置	菊水電子(株)	PLZ1004WH	H27	100	佐々木(大)
185	冷熱衝撃装置	エスペック(株)	TSA-73ES-W	R01	700	伊藤
186	雑音総合評価試験機	(株)ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	H01	890	佐々木(信)
187	ファストランジェント/バースト試験機	(株)ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	H26	150	佐々木(信)
188	低温恒温高湿器	エスペック	PSL-2K	H19	240	佐々木(大)
189	雷サージ試験システム	(株)ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	H13	110	伊藤
190	耐候性試験機	岩崎電気(株)	SUV-W161	H25	1,540	伊藤
191	グローワイヤー試験機	Physics tecnic's Labor	TA03.35(付属チャンバBT-07)	H25	320	伊藤
192	静電気試験器	ノイズ研究所	ESS-S3011A	H29	200	伊藤
193	複合環境試験装置	IMV(株)	EM2502(1250/SA5M)(振動試験機本体) Syn-3HA-40(恒温恒湿槽)	H26	1,720	佐々木(信)
194	衝撃波記録解析装置	Lansmont社	Test Partner TP3-USB	H26	100	伊藤
195	真空乾燥器	EYELA	VOS-450SD	H09	130	遠田
196	自動研磨装置	ビューラー社	AUTOMET2&ECOMET3	H09	170	遠田
197	スクラバー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業(株)	GNE-1500N	H09	180	遠田
198	発熱量測定装置	(株)島津製作所	CA-4PJ	H10	110	遠田
199	粉塵ドラフト	オリエンタル技研(株)	GNS-1800S	H10	110	遠田
200	排ガス分析装置	(株)島津製作所	GC-17A	H10	120	遠田
201	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	H16	110	遠田
202	GC用熱分解装置	(株)島津製作所	PY-2020iD	H21	520	遠田
203	サイクロンサンプルミル	静岡精機(株)	CSM-F1	H20	110	遠田
204	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	三菱化学(株)	AQF-100	H18	730	遠田
205	ビード作製装置	東京科学(株)	TK-4100型	H16	810	遠田
206	ハンディ型燃焼排ガス分析計	(株)テストー	t350システムXL	H23	130	遠田
207	粒度分布測定装置	日機装(株)	MT3300EX2-SDC-H	H25	580	遠田
208	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス(株)	R300SR-H	H26	100	遠田
209	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC 社	ICS-1600	H26	410	遠田
210	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル(株)	BELSORP-max	H26	920	遠田
211	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU665DA	H26	100	遠田
212	CHN元素分析装置	LECO	CHN628	R02	570	遠田
213	ガスクロマトグラフ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8890GC+5977B	R03	1,610	遠田
214	低温恒温恒湿器	タバイエスペック(株)	PL-3SP型	H05	180	遠田
215	ICP質量分析装置	アジレント・テクノロジー(株)	Agilent 7500 Series ICP-MS	H18	1,680	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
216	イオンクロマトグラフ(陰イオン・陽イオン・糖分析システム)	ダイオネクス	ICS-300+2100型	H22	1,570	遠田
217	吸着性能評価装置	Quantachrome社	ChemBET-3000型	H16	700	遠田
218	バイオシェーカー	タイテック(株)	BR-43FL-MR	H23	110	遠田
219	分子量分布測定装置	(株)島津製作所	ProminenceGPCシステム	H25	390	遠田
220	高感度ガスクロマトグラフ	(株)島津製作所	Tracera	H27	470	遠田
221	波長分散型X線装置	(株)リガク	ZSX Primus IV	R01	1,170	遠田
222	紫外可視分光光度計	(株)島津製作所	UV-3600i Plus	R03	420	工藤
223	微粉碎機	中央化工機(株)	MB-1	H09	110	遠田
224	粗粉碎機	三田村理研工業(株)	SR-2	H09	140	遠田
225	凍結粉碎器	日本分析工業	JFC-1500型	H15	300	遠田
226	小型タンデムリング粉碎機	中央化工機商事(株)	TR-LM	H24	110	遠田
227	アスファルト用乾燥機			S46	110	遠田
228	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス	P6330・P5210・TCP202S	H14	110	佐々木(信)
229	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	H17	710	佐々木(信)
230	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント	V2920A	H21	310	佐々木(信)
231	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス	MSO4104	H20	110	佐々木(信)
232	ソフトウェア品質評価試験システム	(株)ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	H26	260	佐々木(信)
233	計測制御ソフトウェア開発システム	National Instruments(株)	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発システム	H23	110	佐々木(大)
234	プレシジョンパワーアナライザ	横河電機(株)	WT3000	H23	180	佐々木(大)
235	絶縁耐圧試験器	日置電機(株)	3159	H14	110	伊藤
236	ネットワーク・アナライザ・システム	アジレント・テクノロジー(株)	E8364A	H14	1,260	黒澤
237	ロックウェル硬さ試験機	(株)アカシ	ATK-F1000	H07	190	内田(富)
238	放射線(α線、β線、γ線)測定器	日立アロカメディカル(株)	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	H23	110	遠田
239	蛍光X線膜厚計	セイコー電子工業	SEA-5120	H06	1,410	岡田
240	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン社	EMXplus型(マイクロ波ブリッジ含)	H25	1,830	菅原
241	薄膜・粉末両用型高輝度X線回折装置	リガク	SmartLab9K-INP	H29	2,580	菅原
242	イオンスパッタ装置	日本電子(株)	JUC-5000	H04	2,040	岡田
243	マイクロオージェ電子分光装置	日本電子(株)	JAMP-7830F	H14	9,270	岡田
244	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日本電子(株)	JSM-7900F	H30	5,490	菅原
245	実体顕微鏡	オリンパス	SZH-141	H04	350	岡田
246	光電子分光装置(ESCA)	アルバックファイ	5600MC	H04	17,910	千葉
247	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	H27	770	千葉
248	高感度マグネットメータ	プリンストンメジャメント社	MicroMag2900	H05	4,510	山根
249	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	H17	1,410	山根
250	ポータブル型分光測定装置	ARCopix S.A.社	ARCSpectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	H26	210	山根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
251	モノクロメータ式分光光源	朝日分光(株)	MAX-303+,CMS-100	H27	200	山根
252	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	H22	120	笠松
253	恒温恒湿槽	ADVANTEC	AGX-224	H07	310	遠田
254	ダイヤモンド研磨システム	マルトー	ML-150P	H05	110	岡田
255	低速切断機	サウスベイトテクノロジー	SBT650	H05	110	岡田
256	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	H27	470	伊勢
257	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H16	110	小松
258	純水・超純水製造装置	アドバンテック	RFU655DA・RFP543RA	H22	240	山根
259	金属顕微鏡	ニコン	XPF-UNRB	H04	960	伊勢
260	ハイトゲージ	ハイデンハイン	CERTO-CT60M	H06	430	伊勢
261	静電式パターニング装置	エンジニアリングシステム(株)	QDX500-V-XC	H25	1,130	伊勢
262	ダイシング・ソー	ディスコ	DAD320	H07	1,470	内田(勝)
263	摩擦摩耗試験機	ブルカー・ジャパン(株)	UMT-TL-BASE	R01	900	関根
264	スパッタ・蒸着複合装置	トッキ	SPS506	H07	3,980	山根
265	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ	RF-MN750	H19	220	山根
266	バッチ式多元スパッタ装置 ※	トッキ	SPM506	H07	3,820	熊谷(篤)
267	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	H17	440	内田(勝)
268	スパッタリング用パルス電源	日本MKS	RPG-50A-00	H17	290	内田(勝)
269	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンIV	H04	1,940	田口
270	クライオコンプレッサー	ブルックス・オートメーション社	8200空冷式	H26	100	田口
271	バッチ式多層スパッタ装置 ※	日電アネルバ	SPF-540H特	H04	2,570	熊谷(篤)
272	バッチ式スパッタ装置 ※	日電アネルバ	SPF-332H	H06	2,040	熊谷(篤)
273	ディスクスパッタ装置	日本真空技術	SSH-4S	H05	12,570	山根
274	超高真空多元スパッタ装置 ※	アルバック	MPS-4000-C6	H15	6,130	熊谷(篤)
275	純水・超純水製造装置	日本ミリポア(株)	Milli-Q Integral 10	H21	230	田口
276	工場顕微鏡システム	ニコン	MM-11U	H04	2,990	伊勢
277	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	H15	1,990	伊勢
278	超音波洗浄装置	本多電子	W118	H07	450	内田(勝)
279	サンプリングオシロスコープ	レクロイジャパン	9354TM	H07	160	黒澤
280	高速スペクトラムアナライザ	HP	E4401B	H11	280	黒澤
281	高速パルスジェネレータ	HP	HP81110A	H11	240	黒澤
282	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチ	FS725	H17	110	黒澤
283	電波暗室・EMI測定システム	Rohde&Schwars	ESIB26a	H16	9,740	黒澤
284	電波暗室用センサスキャナ	デバイス	DM3423AV1/0	H19	210	黒澤
285	発振器	エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	H19	110	黒澤
286	ロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	H19	110	黒澤
287	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	H20	110	黒澤

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
288	高利得マイクロ波アンテナ	Electro Metrics	EM-6969	H21	110	黒澤
289	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	Schwarzbeck Mess Elektronik	NNBM8125	H21	110	黒澤
290	CISPR22対応電波吸収体	TDK	IS-030A	H22	110	黒澤
291	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンスジャパン	KEC法測定システム	H22	120	黒澤
292	雑音電力測定システム	(株)東陽テクニカ	MAC600A-AJ, EPS/RFP-AJ	H25	100	黒澤
293	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業(株)	KNW-2208, KNW-441, およびF-51	H25	100	黒澤
294	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	H26	150	黒澤
295	放射・伝導イミュニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3, IEC61000-4-6 2008対応	H27	1,400	黒澤
296	車載機器放射イミュニティ用アンテナ	東陽テクニカ	イミュニティ試験システム	H29	200	黒澤
297	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー(株)	DSOX6004A	H30	140	黒澤
298	EMS用発信器	ローデ・シュワルツ社	SMB100B	R01	110	黒澤
299	ミリ波帯アンプ付アンテナ	(株)テクノサイエンスジャパン	LB-180400Hほか	R03	100	黒澤
300	電子負荷	(株)計測技術研究所	LN-300A-G7	H26	100	木谷
301	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	H27	250	木谷
302	EMレシーバー	ローデ・シュワルツ社	ESW-26, TEPTO-DV/RE, TEPTO-DV/CE, TEPTO-DV/PE	H30	880	木谷
303	電源周波数磁界イミュニティ試験装置	(株)テクノサイエンスジャパン	IEC61000-4-8対応	R02	190	木谷
304	触針式表面形状測定装置	アルバック	DEKTAK150	H21	250	千葉
305	超微小硬度計 ※	日本電気	MHA-400	H04	14,980	熊谷(篤)
306	高分解能走査型プローブ顕微鏡	ブルカー・ジャパン(株)	Dimension Icon	R02	2,000	久住
307	分光エリプソメータ	日本セミラボ(株)	SE2000	H28	1,130	山根
308	分光エリプソメータ用反射率測定モジュール	日本セミラボ(株)	SE-2000用	H30	440	山根
309	MTF評価装置	トライオプティクス	Image Master HR LP	H21	550	梁瀬
310	金属顕微鏡システム	オリンパス	BH3-MJL	H06	1,520	梁瀬
311	MTF評価装置	(株)エフケー光学研究所	MATRIX-CS	R03	670	梁瀬
312	ナノ加工用イオンビーム装置	セイコーインスツルメンツ(株)	SMI2050	H14	4,090	伊勢
313	クリーンブースB(H17導入)	日本エアーテック	ECB02-22D5	H17	130	伊勢
314	スペクトラムアナライザ	HP	HP4396B	H09	930	小松
315	FFTアナライザ	HP	HP35670A	H05	1,150	小松
316	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	H05	620	小松
317	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	H05	340	小松
318	FFTサーボアナライザ	HP	HP35670A	H07	640	小松
319	高分解能光ファイバー式変位計	フォトリクス	ATW-01 + ATP-A20	H12	220	小松
320	高周波連続可変フィルタ(H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H13	110	小松
321	FFTアナライザー	アジレントテクノロジー	35670A	H17	170	小松
322	5ch 静電容量変位計	ナノテックス	PS-III-5D	H17	110	小松
323	オートコリメータ	ニコン	6B	H18	220	笠松

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
324	超高分解能光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BH20	H18	110	小松
325	平面検出型光学スケール	Sony Manufacturing Systems Corporation	BZ	H18	110	小松
326	FFTアナライザー	小野測器	DS-2100	H19	220	小松
327	マイクروسコープ	ハイロックス	KH-7700	H19	230	小松
328	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチュアリングシステムズ(株)	BH20	H20	110	小松
329	ロジックアナライザ	アジレントテクノロジー(株)	16804A	H20	240	小松
330	オシロスコープ	アジレントテクノロジー(株)	DSO7104A	H21	110	小松
331	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチュアリングシステムズ	BH25, BD96-B1400HC特	H21	120	小松
332	ファンクションジェネレータ(2ch出力)	テクトロニクス(株)	AFG3252	H21	110	小松
333	レーザ干渉変位計システム	(株)小野測器	LV-2100	H21	130	小松
334	除振台	明立精機	MAPS-008A-G1010	H22	270	小松
335	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)	L-trace II	H24	680	小松
336	レーザドップラ振動計	小野測器	LV-1800	H25	140	小松
337	振動周波数分析器	(株)エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	H25	130	小松
338	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	H26	100	小松
339	ピコメートル分解能非接触変位計	(株)マグネスケール	BN100	H26	100	小松
340	高分解能反射型レーザースケール	(株)マグネスケール	BF1,BD-96	H26	100	小松
341	差動型非接触振動計	小野測器(株)	LV-1800	H26	150	小松
342	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー	DSOS104A	H29	230	小松
343	小型赤外線サーモグラフィ	(株)アピステ	FSV-210L	H30	170	小松
344	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	H10	110	山根
345	発振器	HP	HP81110A	H11	240	木谷
346	クリーンブースC(H17導入)	日本エアテック	ACB-352C-特型	H07	130	木谷
347	光学顕微鏡	ニコン	MM-11U	H07	590	木谷
348	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H09	440	木谷
349	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	H11	680	木谷
350	オシロスコープ	AgilentTechnologies	54622A	H12	110	木谷
351	高精度スピンスタンド	協同電子システム	LS1000/500PS- II K	H16	2,510	木谷
352	磁気抵抗測定装置	ハヤマ	MRMS-10K	H20	3,770	黒澤
353	スイッチ・マトリクス	ケースレーインズツルメンツ(株)	4200-UL-LS-12	H21	110	黒澤
354	GPIB直流電源装置	菊水電子	PBX40-5	H05	260	木谷
355	粘度計	ブルックフィールド社	DV2TCP	H29	100	遠田
356	表面張力計	協和界面科学	DY-500	H29	170	遠田
357	小型旋盤	エムコ社	コンパクト8	H05	590	小松
358	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	H05	280	小松

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
359	静電力発生用高圧電源システム	松定プレジジョン	HAR-30P73.3	H27	100	小松
360	ハイスピードマイクロスコープ	キーエンス	VW-9000	H28	400	笠松
361	LCRメータ	HP	HP4284A	H07	610	小松
362	ズーム顕微鏡	ユニオン光学(株)	DZ2-SH	H09	230	笠松
363	B-Hループメータ(解析装置付き) ※	テスラ	MODEL4800(解析装置: マイテック: 高感度 M-VSM500R)	H04	1,360	熊谷(篤)
364	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	H05	230	内田(勝)
365	マルチメータ	HP	HP3458A	H05	340	内田(勝)
366	アンプ付き電流プローブ	ソニーテクトロニクス	AM503S+op05	H11	110	木谷
367	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	H16	110	木谷
368	インピーダンスアナライザ ※	HP	HP4291A	H06	1,680	熊谷(篤)
369	大規模データ処理用並列分散計算クラスタリングシステム	IBM	eServer325	H16	150	黒澤
370	高周波連続可変フィルタ(H11導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H11	180	木谷
371	フォトソングラフ用クリーンオープン	榎本化成	CSO-402BF	H12	160	内田(勝)
372	スピニングコータ	ミカサ(株)	MS-A150	H21	140	内田(勝)
373	液晶配向シミュレータ	シンテック(株)	LCD MASTER 3D	H18	190	梁瀬
374	ラビング装置	E.H.C(株)	MR-100	H18	270	梁瀬
375	UV加圧硬化装置	E.H.C	MLP-320G	H19	110	梁瀬
376	シール剤塗布装置	岩下エンジニアリング	Ez-ROBO5/ACCURA DG	H20	110	梁瀬
377	アッペ屈折計	アタゴ	DR-M4/1550	H21	110	梁瀬
378	ヘッド観察用顕微鏡セット(ポアスコープ)	オリンパス	G080- 034-090-55	H05	110	梁瀬
379	照明光学系設計システム	Zemax社	OpticStudio Professional版	H27	220	梁瀬
380	高速カメラ	(株)ディテクト	HAS-D3M	H25	110	笠松
381	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業(株)	BHS-751-P型	S62	110	梁瀬
382	高性能LD光源	メレスグリオ	56RCS002/HV	H21	110	梁瀬
383	色彩輝度計	コニカミノルタ	分光フィッティング方式 CS-200	H25	130	梁瀬
384	可視光対応光スペクトラムアナライザ	横河計測	AQ6374-10-L1-D/FC/RFC	R02	340	梁瀬